

英国VSW Atomtech社製品

サドルフィールド型アトムソース

VSW Atomtech社製サドルフィールドファーストアトムビーム (FAB)ソースは電荷を持たない中性の直線ビームを成生します。不安定で低出力の従来の冷陰極の常識を変え、ビームを中性化することでこれまで電荷粒子が問題になっていた誘電体や半導体への照射やエッチングプロセスにも適用が可能になりました。



FAB110サドルフィールドファーストアトムソースは様々な材料のアトムビームエッチングとスパッタリングに効果的です。

FABソースの応用はArやXeのような不活性ガスによる基板のクリーニング、スパッタエッチングアトムビームスパッタ蒸着です。

CF₄、SF₆、C₂F₆、C₃F₈、CHF₃、I₂のような活性ガスも半導体材料のミリングに利用されます。

用途

- ◆ 成膜前の基板クリーニング
- ◆ 常温接合前のサンプルのクリーニング、表面の活性化
- ◆ 半導体基板等のエッチング
- ◆ 微細加工
- ◆ リアクティブアトムビームエッチング

特徴

- ◆ 電荷を持ったイオンによる衝撃と異なり、絶縁物や半導体試料にもチャージダメージなし
- ◆ ビームが電荷を持たないので電場や磁場中でも曲がらず直進します

仕様

・最大出力電流	2
・ビームエネルギー (keV)	0.8—2.3
・最大入力パワー	100
・最大プラズマ電流 (mA)	40
・ガス流量 (sccm) 1セル、2セル	4、6
・動作真空度 (mbar)	1×10 ⁻³
・冷却水 (L/min 20°C)	2
・寸法	45x80x40mm

ご注文、お問合せ先

三和真空 株式会社

〒143-0013 東京都大田区大森南4-6-15 テクノ FRONT 森ヶ崎307

TEL: 03-5735-5656 FAX: 03-5735-5655

URL: <http://www.sanwa-vacuum.co.jp>